

電子系教學實驗室公告

公告日期：105 年 8 月 26 日

主旨：欲申請使用電子系教學實驗室設備者，請按下述相關規定提出申請。

說明：

- 一、電子系教學實驗室內之設備含：濕式工作台(Wet Bench)、黃光室設備(考核含光阻塗佈機、光罩對準曝光機、加熱器、顯影清洗)、高溫爐管系統、電子鎗蒸鍍系統(E-Gun)、薄膜測厚儀(alpha stepper)、光學薄膜測厚儀、真空濺鍍系統(Sputter)、PECVD(PD240)、PECVD(Lee)、LPCVD(Lee)。
- 二、電子系教學實驗室內之設備僅限交通大學電子工程系與電子研究所之人員申請自行操作。欲申請使用電子系教學實驗室設備者，請自行至奈米中心網頁下載非奈米中心儀器訓練申請表(一部儀器設備填寫一張)。
- 三、使用爐管設備者，須先通過 Wet Bench 考核。
- 四、擔任電子系半導體實驗課程助教者，仍須通過設備考核後方可擔任。
- 五、訓練考核事宜，請洽系上技術員許俊生先生(分機 55618; email: jshsu@mail.nctu.edu.tw)。

電子系教學實驗室負責人

侯拓宏